

感应耦合等离子刻蚀机

所属学校:重庆大学

仪器基本信息			仪 器 编 号		08023814					
			仪器英文名称		STS LPX ICP ASE SR System					
			所属校内单位		光电工程学院					
			放 置 地 点		A 区微系统研究中心					
			仪器负责人		尚正国	制造商国别	英国			
			制 造 厂 商		STS 公司					
			规 格 型 号		MP0597					
			仪 器 原 值		293.50 万元	购置日期	2008.12			
仪器性能信息	主要技术指标	极限真空 2×10^{-6} Torr, 工艺 A 刻蚀均匀性 $\pm 2.62\%$, 角度 $89.68^{\circ} \sim 89.91^{\circ}$; 工艺 B 刻蚀均匀性 $\pm 1.78\%$, 角度 $89.78^{\circ} \sim 90.1^{\circ}$ 。								
	主要功能及特色	硅的各项异性深槽刻蚀, 深宽比 $>20:1$, 侧壁陡直光滑。								
相关科研信息	主要研究方向	电子、通信与自动控制技术; 科学研究。								
	在研或曾承担的重大项目	北大深槽刻蚀、24 所深槽刻蚀、电子科大深槽刻蚀。								
	学术 论文	近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文:								
		序号	作者	论文题目		期刊名称		年	卷(期)	起止页
		1	徐溢	流控电泳芯片集成电导检测研究进展		压电与声光		2010	32(4)	671 - 676
专利或奖项										
共享服务信息	收费标准	联盟外	根据具体实验项目协商							
		联盟内	根据具体实验项目协商							
	联系信息	联系人	尚正国	联系电话	65102519	电子邮件	zhengry@cqu.edu.cn			
开放时间	提前预约									